

2022年度第1回
ナノファブスクエア 講習・実習会

フォトマスク作製



川崎市

初心者
歓迎



日本工学会
ECEプログラム認定



日時

2022年5月12日(木)
13:30~16:30 ※講習1時間、実習2時間

場所

NANOBIC 会議室 1
(川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり
JR新川崎駅から徒歩10分)

講師

山本 貴富喜 先生 (東京工業大学工学院 准教授)

実習内容

フォトレジストへのリソグラフィの体験実習

実習機器

レーザー直接描画装置
(Heidelberg Instruments Mikrotechnik社製DWL66fs) *

* 機器詳細仕様は「NANOBICオープンラボ」ホームページ <https://open-labo.skr.jp/> の設備一覧をご覧ください。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「フォトマスク作製講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

定員：先着5名程度 参加費：11,000円(実費+コロナ対策実費)

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

問い合わせ先

篠原俊朗 Tel:080-6560-3061 真期 彰 Tel:080-6560-3060

E-mail: nano-micro@open-labo.jp (地独)神奈川県立産業技術総合研究所

新川崎・創造のもり NANOBIC事務室

※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金 (URL:<https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000127593.html>) がご利用できますのでご相談ください